

XPS、AESを用いた微細構造解析支援

Technical support for Advanced Characterization Using XPS and AES

「技術支援貢献賞」受賞 / Best Technical Support Contribution Award

受賞者: 鈴木 啓太 (北海道大学・ナノテクプラットフォーム エキスパート)

Awardee: Keita Suzuki (Hokkaido University・Nanotechnology Platform Expert)



KEY WORDS

X-ray Photoelectron Spectroscopy, Auger Electron Spectroscopy, CCP, CP, AFM, LSCM, SEM, EBSD, EDS

概要 | Overview

北海道大学ナノテクノロジープラットフォーム事業では「微細加工」「微細構造解析」の2つの領域について、共同利用体制を構築した装置群と技術者のノウハウを用いた研究支援を行っている。本受賞者は本事業に参画している共同利用施設「光電子分光分析研究室」の担当職員として装置管理と利用者への支援を行っている。ここでは本共同利用施設についてとXPS及びAESについての支援事例を紹介する。

Hokkaido University Nanotechnology Platform Project, research support is provided in the two areas of "Nano-fabrication" and "Advanced characterization" using a group of instruments that have been established as a joint use system and the know-how of. This awardee is a staff member of "Laboratory of XPS analysis(Joint-use facilities)", which is participating in this project, and manages the equipment and provides support to users. In the following, this facility and cases of support for the XPS and AES will be introduced.

光電子分光分析研究室設備について

Instruments of Laboratory of XPS analysis

北海道大学 光電子分光分析研究室は主に固体材料極表面の観察・形状評価・化学状態分析について、試料加工等の前処理から解析までの支援を行う共同利用施設である。ナノプラット事業に参画し、主に下記の設備を用いて学内外の幅広い分野の利用者への技術支援を行っている。

● X線電子分光装置(XPS) JPS-9200(JEOL)

試料にX線を照射し、生成した電子の運動エネルギーを測定することで深さ数nmの試料表面の組成、化学状態分析を行う。Mg-K α /Al-K α 二つのX線源と複数のX線源があり、Ar $^{+}$ イオンエッティングを利用したデブスマップファイル測定、マッピング測定、角度分解測定、全反射測定に対応出来る。大気非露導導入用トランസフアーベッセルも保有している。



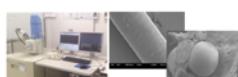
● オージェ電子分光装置(AES) JAMP-9500F(JEOL)

FE-SEMに同心半球型分光鏡を備え、電子線照射で生成したオージェ電子の運動エネルギーを測定し、深さ数nmの試料表面の組成、化学状態分析をSEM観察と共に実行。Ar $^{+}$ イオンエッティングを利用したデブスマップファイル測定、マッピング測定の他、反射電子像観察、結晶方位解析(EBSD)、トランസフアーベッセルを使用した大気非露導導入也可能である。



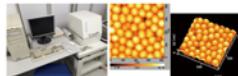
● 走査電子顕微鏡(SEM) JSM-6510LA(JEOL)

熱電子線タイプの汎用SEM。EDSによる元素分析、反射電子像観察の他、低真空(10~270 Pa)モードでの観察、分析も可能である。簡単ながら必要十分な設備であり、初学者含め幅広い分野のユーザーに使用されている。



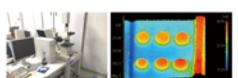
● 原子間力顕微鏡(AFM) SPA-400(Hitachi High-Tech)

カンチレバーの探針を用い、カンチレバーに照射したレーザーの反射による光起電力を用いて試料表面をなぞる。または一定間隔を保って表面を走査することで、形状像を主とした各種物性の画像をナノメートルスケールで取得する。LSCMと共に試料表面の凹凸評価に用いられる。



● 共焦点レーザー走査顕微鏡(LSCM) 1LM21D(Lasertec)

共焦点光学系のレーザー光を用い、試料表面を走査しながらステージ高さを移動することで、全焦点画像と2次元高さ画像をマイクロメートルスケールで取得する。AFMと共に試料表面の凹凸評価に用いられる。



● クロスセクションポリリッシャ(CP) SM-09010(JEOL)

及びクラウイ-CP(CC-P) IB-19520CP(JEOL)

共焦点光学系のレーザー光を用い、試料表面を走査しながらステージ高さを移動することで、全焦点画像と2次元高さ画像をマイクロメートルスケールで取得する。AFMと共に試料表面の凹凸評価に用いられる。

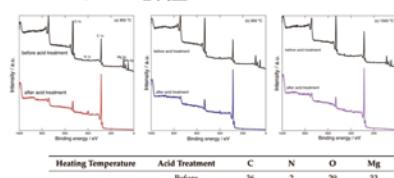


XPSによる技術支援事例

Examples of Technical support by XPS

● 事例1. 硝素含有メソポーラスカーボンの評価

含窒素高分子であるポリビニルピロリドンと酸化マグネシウム前駆体の混合物を加熱して得られる炭素質固体の、酸処理前後でのXPS測定支援を行った。スペクトルの評価により、酸処理によって酸化マグネシウム結晶が除去され、窒素含有メソポーラスカーボンとなったことが確認できた。

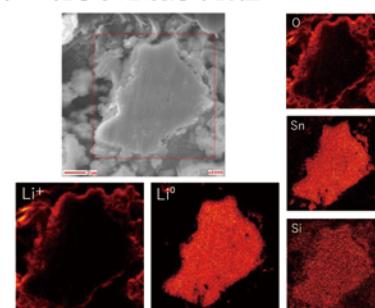


Tomoya Takada et al., Journal of Carbon Research, 2019, 5(2), 15

大谷恭平 他、材料と環境, Vol.68, No.8, 205-211(2019)

● 事例2. 3元系Li合金粉体試料のLi化学状態別分布評価

より温和な条件でアンモニア合成が行えるとされる3元系14族合金(Li_xSi_ySn_z)の粉体試料について、Ar $^{+}$ イオンミリングにより試料断面作製とAES分析を支援した。試料合成からCCPミリング加工、AES導入に至るまでトランസフアーベッセルを使用して大気非露導輸送を行った。ケミカルシフトを利用して金属LiとLi $^{+}$ の化学状態別マッピング分析により、粉体の表層部でLi₂Oが、内部ではLiが合金として存在していることが確認できた。



CONTACT

鈴木 啓太 Keita Suzuki
北海道大学 光電子分光分析研究室/Laboratory of XPS analysis, Hokkaido University
URL : <https://xpslab.eng.hokudai.ac.jp/>